

附件 1

JEM-F200 场发射透射电子显微镜功能参数

一、基本功能

- 1.可进行微观结构分析，拍摄明场像、暗场像、高分辨像、扫描透射高角环形暗场像；
- 2.可进行选区电子衍射和会聚束电子衍射，分析微区晶体结构、样品厚度以及材料应变场；
- 3.配备能谱仪，可进行微区成分分析。

二、技术指标

- 1.TEM 点分辨率: 0.23 nm@200 kV, 线分辨率: 0.10 nm@200 kV;
- 2.STEM-HAADF 分辨率: 0.16 nm@200 kV;
- 3.能谱仪 (EDS) 能量分辨率: 136 eV。

三、仪器特色

- 1.搭载冷场发射电子枪，最高分辨率达 0.1 nm;
- 2.能够实现自动进出样品杆；
- 3.配有双探头超级能谱仪（探头面积 200 mm²），能够在任意样品倾角下实现快速高精度的 EDS 分析；
- 4.搭载 RIO16 高速相机。